

SPEAKER

MI Tutorial 2026



안정호 PL
삼성전자

Biography

- **학력:** KAIST 기계공학 박사 (응용 광학, 2010)
- **경력:**
 - 2010 ~ 현재: 반도체연구소 Metrology & Inspection 기술 개발
 - 현) 반도체연구소 MI 기술팀 PL
- **전문 분야:** Advanced Semiconductor Metrology & Inspection, 광학 및 전자빔(e-Beam) 기반 계측·검사 기술, 미세 공정 결함 제어 및 수율 분석

Abstract

본 강의에서는 반도체 제조 공정 중 발생하는 주요 불량을 제어하는 검사(Inspection) 기술의 기초 개념과 핵심 원리를 소개합니다. 광학 및 전자빔(e-Beam) 검사의 기본 메커니즘과 개발 환경에서의 적용 사례를 중심으로 결함 검출의 기초를 알기 쉽게 설명합니다. 또한 기존 기술의 발전 흐름과 현재 소자 개발 단계에서 마주한 기술적 과제를 짚어보며, 검사 공정의 전반적인 맥락을 이해하도록 돕습니다. 나아가 차세대 공정으로의 진화에 따른 미래 검사 기술의 방향성을 조망하며, 반도체 검사 분야의 기본기를 다지는 입문 계기를 제공합니다.